

O2气体分析仪 氧气分析仪 激光气体分析仪 氧气在线监测系统

产品名称	O2气体分析仪 氧气分析仪 激光气体分析仪 氧气在线监测系统
公司名称	武汉正元环境科技股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:武汉正元 型号:ZYG-6000-A
公司地址	武汉武昌藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智 天地5栋A座3楼
联系电话	02765382290 13871339889

产品详情

一、产品概述ZYG-6000激光气体分析仪基于可调谐半导体激光吸收光谱技术原理进行测量，半导体激光器发射出特定波长的激光束，穿过被测气体时，进行定量分析。

二、适用范围

主要应用在工业过程气体分析、生物发酵和食品等行业。三、技术规格四、工作原理 激光过程气体分析系统基于半导体激光吸收光谱技术（TDLAS），即“单线光谱”测量技术。系统采用可调制的半导体激光器为发光光源，通过调制半导体激光器的工作电流强度来调制激光频率，使激光扫描范围略大于被测气体的单吸收谱线。从而使半导体激光器发射的特定波长的激光束在穿过测量管时，被被测气体选频吸收，从而导致激光强度产生衰减。于是系统利用不同气体成分均有不同的特征吸收谱线及气体浓度和红外或激光吸收光谱之间存在的 Beer-Lambert 关系，通过检测吸收谱线的吸收大小（即激光强度衰减信息）就可以获得被测气体的浓度。但不同的是，传统非分光红外分析技术使用谱宽很宽且固定波长的红外光源，而 DLAS 技术使用谱宽较小(也就是单色性较好)且波长可调谐的半导体激光器作为光源。因此，TDLAS技术具有传统非分光红外分析技术无法实现的一些性能优点。半导体激光器发射的激光谱宽小于 0.0001nm，是红外光源谱宽的 1/106，远小于红外光源谱宽和被测气体单吸收谱线宽度，其频率调制扫描范围也仅包含被测气体单吸收谱线（半导体激光吸收光谱技术也因此被称为单线光谱技术），因此成功消除了背景气体交叉干扰影响。不受被测气体环境参数变化干扰被测气体环境参数—温度或压力变化通常导致谱线强度和展宽发生变化，对温度或压力 信号不加修正就会影响测量结果。而TDLAS技术是对被测气体单一吸收谱线进行分析，因此可较容易地对温度、压力效应进行修正。为此系统内置了温度和压力自动修正功能，能根据实际测量得到的被测气体温度和压力对气体成分测量值进行自动修正，从而可实现精确的在线气体分析。综上所述，单线光谱技术、激光波长扫描技术和环境参数自动修正技术使 TDLAS 技术可以被用于实现气体的在线分析，因此比非分光红外等传统采样气体分析系统具备更强的环境适应性。四、现场安装实例 五、产品特点 可安装在过程气体管道中，无需复杂的采样和预处理系统，结构简单、无运动部件。仪器采用液晶屏显示，低功耗、宽视角、优越的低温性能，-40 可正常显示。按键操作采用高灵敏

度的霍尔按键，可以方便快捷的响应磁笔操作。 ZYF-6000隔爆型系列分析仪具有安装简便、维护简单、维护周期长、可靠性高、适应性强等特点。 ZYF-6000是LGT系列产品中用于取样安装的半导体激光气体分析产品，能对各种工业过程气体、环保排放烟气等过程气体进行快速、准确和可靠的测量。采用的多路反射测量池，能有效的增加气体的测量下限，可以满足PPM级别的气体检测需求。

